## 科学研究費補助金研究成果報告書

平成 23 年 3月 31 日現在

機関番号: 12701 研究種目:若手研究( 研究期間:2009 ~ 課題番号:21760552 研究課題名(和文)	B) 2010 金属/セラミックス接合界面の測定応力によるせん断強度の定量的評価			
研究課題名(英文)	Evaluation of shear strength on metal/ceramics interface by stress measurement			
研究代表者				
長谷川 誠( HASEGAWA MAKOTO )				
横浜国立大学・工学研究院・准教授				
研究者番号:50376	513			

研究成果の概要 (和文) : 金属とセラミックスが接合したコーティング材料、電子デバイスなど では、材料内の残留応力および外部負荷によるせん断応力による界面剥離が問題となっている。 本研究では熱遮蔽コーティング材料をモデル化した材料を作製し、材料中の Al2O3のせん断応 力の状態およびモード II での界面剥離エネルギー開放率を求めた。応力成分は EBSD 法を用 いて得られる Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の結晶方位の情報とレーザーを用いた蛍光分光法により得られるピークの 位置情報より算出し、応力成分を変換することで、せん断応力成分を求めた。

研究成果の概要(英文): Delamination of an interface under shear loading by the residual stress of the material or mechanically applied load is one of the problem in metal/ceramics bonded interfaces such as coating materials and electric devices. In this research, modeled materials of thermal barrier coatings are formed by diffusion bonding and air plasma spray method. Stress distribution of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and interfacial strain energy release rate in mode II loading condition on Ni(Pt)Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> interface were evaluated. Stress components were decided by the crystal orientation of  $Al_2O_3$  measured from EBSD technique and stresses measured from the photo-stimulated luminescence spectrum method. Shear stress components were decided by converting the stress component.

交付	決定額			
				(金額単位:円)
		直接経費	間接経費	合 計
	2009 年度	2,900,000	870,000	3, 770, 000
	2010 年度	600, 000	180,000	780,000
	年度			
	年度			
	年度			

3,500,000 1,050,000 総 計 研究分野:工学

科研費の分科・細目:材料工学・構造・機能材料 キーワード:強度・靱性・界面・せん断応力・結晶方位・蛍光分光法

## 1. 研究開始当初の背景

近年、コーティング材料、電子デバイスな ど金属とセラミックスが接合した材料が多 く利用されている。材料内の残留応力および 外部負荷によるせん断応力によって界面剥 離が生じ、コーティング材料やデバイスの信

頼性が著しく低下することが問題となって いる。

4,550,000

従来、界面剥離や破壊の問題に関しては、 界面に垂直な方向へ力が加わるモードIでの 剥離に主眼が置かれており、報告者も局所応 力測定と結晶方位測定の両方の情報をもと

に Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の応力成分を実験的に求める手法を 確立し、応力基準でのモードIでの剥離開始 条件を明らかにした。また、Cu と単結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の接合体を対象に、エネルギー基準で のモードIでの接合界面の剥離進展条件を界 面剥離エネルギー開放率により検討してき た。しかし、界面にせん断応力が加わるモー ドIIでの界面剥離の問題は、せん断応力下で の界面力学特性が重要であるにもかかわら ず、剥離の開始および進展についての定量的 評価の試みは非常に少ない。これまでに界面 にせん断負荷が加わるモード II での剥離の 開始に影響を与える応力に着目した国内・国 外の研究は、主に2種類に分類される。1つ 目は、理論的解析からの手法である。モード Ⅱでの剥離開始についての研究例は極めて少 ないが、主に第一原理計算を用いて解析され ている(N. I. Medvedeva et al. (2004))。しか し、金属とセラミックスの特定の結晶面での 界面強度しか計算できないことなど、その結 果を実際の材料には応用できない。2つ目は 実験的評価手法である。マクロな試験片を用 いて、接合界面にせん断負荷を加え、界面が 完全に剥離したときの荷重をもとに接合界 面強さを測定する手法が用いられている。し かし、接合体では界面で応力分布を持ち、測 定される応力が寸法や試験方法依存性を持 ってしまうため、得られた応力値を物理量と してとらえ議論することは難しく、接合部材 の設計などで強さの基準として用いること ができない。また、この手法は、コーティン グ材料や電子デバイスには適用できない。

このように、理論的解析は少なく、実際の 材料にも適用できない。また、マクロな手法 を用いた実験的評価は多いものの、局所的な 場所による応力状態や分布を実験的に求め てせん断負荷による剥離現象との関連を調 べた報告は極めて少なく、また不明な点が多 い。界面にせん断負荷が加わるモード II での 剥離進展については、実験的評価手法として 最近になってインデンテーション法が開発 されている(MR. Begley et al. (2000), A.Vasinonta et al. (2001))。界面剥離先端に 純粋なモード II を生じさせることができる が、剥離の進展挙動をこの手法では観察でき ず、剥離駆動力が小さいという問題も残され ている。これらが信頼性を向上させるための 障害となっている。そのため、界面近傍にお いて局所領域での応力測定からせん断応力 状態などを実験的に求め、剥離の開始、進展 を定量的に解釈する手法の確立が強く求め られている。

 研究の目的
(1) Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の応力成分を実験的に求める手法 を発展させ、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のレーザーを絞っての蛍 光分光法による局所応力測定と電子線後方 散乱(EBSD)法による結晶方位測定の両方の 情報をもとに、界面に生じるせん断応力成分 を実験的に求める手法を開発する。

(2) 熱遮蔽コーティング材料をモデル化したNi-26Al、Ni-40Al、Ni-37Al-10Pt-0.5Hf (mass%)合金(以後、Ni(Pt)Alとする)と単結晶あるいは多結晶Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>との接合体を作製し、 接合体にせん断負荷を加えた状態での界面 近傍でのAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のせん断応力の状態、分布を 調べる。また、界面に剥離を導入した接合体 についても、剥離先端近傍についてせん断応 力の状態、分布を調べ、測定結果から界面剥 離機構や剥離開始条件の解明を行う。また、 剥離進展条件の解明のため、モード II での界 面剥離エネルギー開放率を求める。それらの 結果をもとに、剥離開始および進展を定量的 に評価する手法を検討する。

3. 研究の方法

(1) 多結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のせん断応力下での応力状 態決定手法の確立

①せん断応力成分算出手法の確立: 蛍光分光 法はレーザーを絞って Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>に照射し、発生 するAl2O3中に含まれるCr<sup>3+</sup>からの2つの蛍 光ピーク(R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>ピーク)の位置変化量(Δν<sub>1</sub>, Δv<sub>2</sub>)からAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の応力を求めるもので、応力 成分は結晶方位の情報をもとに算出する。測 定時の空間分解能は 1µm 程度と結晶粒 1 つ に対応するため、測定領域内を単結晶と仮定 することができる。自作の小型力学試験機を 用いて、結晶方位が既知のAl2O3単結晶試料 に無負荷状態から力学的負荷を加え、せん断 負荷を加える。せん断負荷が加わる領域を蛍 光分光法で応力を測定し、結晶座標系の応力 成分から試料座標系を基準としたせん断応 力成分に変換し、実験的に算出できることを 確認する。

②せん断応力成分算出手法の Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>多結晶へ の適用:多結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>に力学的負荷を加え、 せん断負荷が加わる領域の結晶方位が未知 の領域について、既に確立している電子線後 方散乱(EBSD)法による結晶方位測定手法と ②のせん断応力成分算出手法を適用し、多結 晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>に対して、それぞれの結晶粒におけ るせん断応力成分を算出できることを確認 する。

## (2) Ni(Pt)Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>作製

Ni-26Al、 Ni-40Al、Ni-37Al-10Pt-0.5Hf (mass%)合金 (Ni(Pt)Al 合金)をアーク溶解 により溶製する。Ni(Pt)Al 合金を用いて、 Ni(Pt)Al/単結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>および Ni(Pt)Al/多結 晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>接合体を高真空ホットプレスにより 作製する。1523 K で 24 時間、3MPa の応力 を負荷して接合させることで健全な接合体 を作製する。接合後、剥離や未接合領域が存 在する場合は、接合条件を変化させ剥離領域 をなくす。剥離や未接合領域の確認はマイク ロスコープで観察して行う。

(3) 接合体のせん断応力下での剥離進展条件の決定

①<u>試験片作製方法</u>:試験に適した試験片を作 製する手法を確立する。試験片は Barb およ び Pushout 試験片を用いる。界面への予き裂 は、繰り返し負荷を加えることで導入する。 また、多結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を用いた接合体の場合、 容易に界面剥離が観察できないことからマ イクロスコープで観察しながら導入する。 ②<u>せん断応力下での</u>剥離進展条件の決定:作 製した予き裂を導入した Ni(Pt)Al/単結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>試験片に無負荷状態から力学的負荷を 加え、剥離進展挙動を観察する。また、荷重 と剥離進展距離から界面剥離エネルギー開 放率を求める。

(4) 接合体の分光装置下でのせん断応力下で の応力状態の決定

①<u>試験片作製方法</u>:力学試験機の使用と試験 片の有効利用のため、小型の Pushout 試験片 を用いて力学試験を行う。界面への予き裂導 入は、負荷方向に繰り返し負荷を加えること で行う。試験片の小型化により予き裂の視認 が難しく、試験片を急速に破壊させないため アコースティックエミッション(AE)も同時 に測定しながら行う。

②溶射による試験片の作製:21年度の接合体 作製法においては、界面にNiAl2O4等の複相 酸化物が形成してしまい、上記試験において 界面の強度が著しく低下してしまったこと から、遮熱コーティングを模擬した材料を作 製する。Ni(Pt)Al合金上に大気プラズマ溶射 法によりZrO2をコーティングし、さらに大 気熱暴露を行うことにより、Ni(Pt)Al/多結晶 Al2O3界面を得る。

③試験片のせん断応力状態の決定:作製した 予き裂未導入および導入した Ni(Pt)Al/単結 晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>試験片について小型力学試験機を用 いて、無負荷状態から力学的負荷を加え、せ ん断応力成分算出手法を適用し、界面近傍で の応力状態、分布を明らかにする。また、予 き裂未導入および導入した Ni(Pt)Al/多結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>試験片についても各結晶粒の結晶方位 を測定後、同様な手法で界面近傍での応力状 態、分布を明らかにする。

④結果のまとめ:最大せん断応力値や応力状態から結晶方位の違いが接合界面強度に及 ぼす影響や剥離発生に最も関係のある応力 成分を明らかにする。

- 4. 研究成果
- (1) 作製した接合界面の状態
- 図1は真空中、1523 K で 36 時間、3MPa

の応力を負荷して Ni(Pt)Al と単結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> を接合させた一例である。この条件では健全 な接合体は作製できず、一割ほど剥離か未接 合の領域が存在するものの、さらに時間と応 力を負荷することにより、マイクロスコープ レベルでは剥離領域が見られない接合体が 作製でした。しかしながら、ちょっとした負 荷で界面が剥離してしまい、界面強度が予想 以上に弱いことから、接合時に界面に何かが 生成したと考え、接合体の界面近傍を対象と して TEM を用いた観察を行った。図2は、 剥離の見られなかった Ni(Pt)Al/単結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 接合体の界面近傍を観察した結果である。生 成物が界面に平行に連続して、厚さ10nm程 度で存在していることがわかる。この生成物 が何かを判断するために、剥離した界面を対



400 µm

図1 Ni(Pt)Al/単結晶Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>界面に存在する剥離領域の一例



図2 剥離の見られなかったNi(Pt)Al/単結晶Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>接合体の界面近傍。界面内に生成物(複相酸化物)が見られる。



図3 XPS解析の一例。剥離した界面の単結晶Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>側 のNi2pからNiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>の存在を示すピークが見られる。

象として、XPSにより構造を調べた。図3は、 剥離した界面の単結晶Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>側についてXPS 解析を行った一例である。866eV付近にピー クが見られるが、このピークはNiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>の存 在を示している。したがって、界面が弱いの は生成した界面にNiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>等の複相酸化物が 形成したためと考えられる。

そこで、Ni(Pt)Al 合金上に大気プラズマ溶 射法により ZrO<sub>2</sub> をコーティングし、さらに 大気熱暴露を行うことにより、Ni(Pt)Al/多結 晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>界面を作製し、試験に供した。

(2) 接合界面における応力成分

レーザーを絞り、空間分解能を 1µm 程度と し、2つの蛍光ピークの位置変化( $\Delta v_1, \Delta v_2$ )を 測定することで、一つの結晶粒における応力 を測定することができる。かつ同一結晶粒の 結晶方位を測定することで、それぞれのピー クでのピーク位置変化量と応力関係  $\Delta v_{ij} = \Pi_{ij}\sigma_{ij}$ から、異方性を利用して各結晶 粒における応力成分を、得られる式①、② から算出することが可能となる。ここで、  $\sigma_y \approx 0$ と仮定している(表面のため)。  $\Delta v_1 = \Pi_x^{(1)}\sigma_x + \Pi_z^{(2)}\sigma_z$  ①  $\Delta v_2 = \Pi_x^{(2)}\sigma_x + \Pi_z^{(2)}\sigma_z$  ②



(a) OM写真、(b) x方向の応力分布、(c) z方向の応力分布

この手法により、剥離発生に最も関係のある 応力成分および応力値を特定することがで きる。さらには、得られた応力**σx**, **σ**z は結晶 座標系の応力成分であり、界面を基準とした 応力成分ではないため、応力のモール円を用 いて界面に加わるせん断応力成分を算出す ることが可能になる。

Ni(Pt)Al/多結晶Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>試験片に負荷を加え た状態において、結晶方位分布が既知の Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>多結晶体を対象として蛍光分光法によ り2つのピークの位置を特定し、その情報を 基に応力成分を求めた。レーザーの焦点は表 面に合わせて測定している。図4は負荷が加 わっている Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の応力成分を測定した一例 である。(a)は測定した領域の組織であり、 (b)はx方向、(c)はz方向の応力分布を示し ている。y 方向は表面を測定しているため、 応力が開放されていると考えゼロとした。 Ni(Pt)Al 合金に近い Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の応力は x 方向に 高い圧縮応力、z 方向に低い引張り応力が働 いており、Ni(Pt)Al 合金から離れるにつれて x 方向の圧縮応力は低くなり、z 方向の引張 り応力は高くなっていることがわかり、これ らの応力成分から、せん断応力成分も応力の 変換により取りだせることが見出された。

従来は静水圧状態を仮定することにより 平均応力しか求めることができなかったが、 結晶方位の情報を用いることで、応力成分を 分離して、各応力成分での応力分布を求める ことができるようになり、かつ、応力変換に よりせん断応力成分も取り出せた。十分な解 析は今後も必要ではあるが、応力成分を用い た界面での剥離発生を理解する手法が見出 され、この手法による解析は有効と思われる。

## (3) せん断負荷による界面破壊靱性

試験片の有効利用のため、Barb 試験片か ら小型の Pushout 試験片を用いて力学試験 を行った(図5)。これにより、溶射とその 後の熱暴露により作製した Ni(Pt)Al/多結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>試料についても試験が可能となった。 図6は Pushout 試験における荷重-変位

曲線の一例である.負荷の初期においては、



図5 Pushout試験片形状と負荷方向



図6 荷重-変位曲線の一例

試験機系全体のコンプライアンスの変化に よると思われる非線形な挙動を示すものの、 その後は最大荷重まで、おおむね線形に荷重 が増大している。最大荷重まで到達後、界面 近傍での剥離により荷重がゼロとなった。

Ni(Pt)Al/多結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>試験片の界面剥離エ ネルギー開放率は 250~50J/m2 と広い範囲 に分布した。熱暴露時間の増大に伴い界面剥 離エネルギー開放率が低下し、また、Ni(Pt)Al 合金側の降伏応力の低下に伴い界面剥離エ ネルギー開放率が増大する傾向にあった。熱 暴露に伴い、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>層が形成し Ni(Pt)Al/多結 晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>試験片となるが、残留応力が熱暴露 時間に伴い高くなるため、剥離エネルギーが 低下したと考えられる。一方、降伏応力の低 下に伴い、き裂先端の塑性域が大きくなるた めエネルギーが散逸し、剥離エネルギーが増 大したと考えられる。

以上のことから、溶射とその後の熱暴露に よる Ni(Pt)Al/多結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 試験片の作製と その後の解析はある程度成功しているもの の、生成する Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>層の厚さや Ni(Pt)Al の降 伏応力の制御が難しく、条件を一定とした試 験がかなり難しいことから、より詳細な実 験・解析に使用できる Ni(Pt)Al/単結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、 Ni(Pt)Al/多結晶 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>試験片の作製には、H<sub>2</sub> などの還元雰囲気中でのホットプレスによ る拡散接合が求められる。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

 6.研究組織
(1)研究代表者 長谷川 誠(HASEGAWA MAKOTO)
横浜国立大学・工学研究院・准教授 研究者番号: 50376513

(2)研究分担者

(3)連携研究者